# 量子井戸構造を伴う半導体レーザの動特性

Dynamic Properties of Quantum Well Lasers

# 荒川泰彦\* Yasuhiko ARAKAWA

半導体レーザにおいて,変調帯域幅を拡大することや量子雑音を軽減することは,実用上極め て重要なことである.本解説では量子井戸構造を伴う半導体レーザの利得特性,変調特性,雑 音特性等に関し議論し,これらの特性を改善できることを明らかにし,量子サイズ効果の有用 性を示す.また,量子井戸細線レーザの概念・基本特性についても論じる.

#### 1. はじめに

最近の分子線結晶成長技術や有機金属結晶成長技術の 発展に伴い、100Å程度の半導体超薄膜を活性層に持つ量 子井戸半導体レーザが作成されるようになり、広く注目 を集めている<sup>1-8)</sup>.この量子井戸レーザにおいては、実用 上重要な特性である発振に必要な閾値電流、変調帯域幅、 発振スペクトルの純度(スペクトル線幅など)などが、 従来の半導体レーザと比較して大きく改善されることが 明らかになってきている.本解説では、筆者が1984年か ら1986年にかけて米国カリフォルニア工科大学で行った 研究を中心に、量子井戸レーザの動特性について論ずる ことにしたい.

以下では、量子井戸レーザの利得特性、変調特性、お よび量子雑音特性等を明らかにし、構造パラメータであ る量子井戸幅、量子井戸の数等のこれらの特性に及ぼす 効果についてのべる<sup>8-10)</sup>.また量子井戸細線効果や量子 井戸箱効果を伴う半導体レーザのダイナミックスについ て議論する<sup>11-15,47)</sup>.

#### 2.利得特性

### 2.1 はじめに

この章では,量子井戸レーザの利得特性,および閾値 電流特性について述べることにしよう.

### 2.2 状態密度

量子井戸(Quantum Well:QW)構造においては,量 子井戸の厚さ方向に関して電子が量子化される.このた め単位エネルギ・面積当たりの電子が占めることができ る状態密度は単一量子井戸(Single Quantum Well: SQW)の場合,次式で与えられる.

$$\rho_{c}(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m_{c}}{\pi \hbar^{2}} H[E - \varepsilon_{n}]$$
(1)

\*東京大学生産技術研究所 第3部

ここでH[x],  $m_{c}$ ,  $\hbar$ , および $\epsilon_n$ は, それぞれヘビサイド 関数,電子の有効質量, プランク定数を2πで割ったもの, 第n番目の量子化された電子のエネルギレベルである. もし量子井戸の障壁の高さが十分高くかつ障壁の厚さが 十分大きければ,  $\epsilon_n$ は $(n\pi\hbar)^2/(2mcL_z^2)$ で与えられる.

ここでL<sub>z</sub>は量子井戸の厚さである.図1に量子井戸構 造の概念図と状態密度の形状を示す.この図からわかる ように状態密度は階段状になっている.これは従来の3 次元自由度をもつ電子の状態密度関数とは大きく異なる ものである.

量子井戸が複数で(多重量子井戸:Multi-Quantum Well:MQW)かつ量子井戸間に結合があるときには、 状態密度の形が変わる<sup>16-18)</sup>.以下では、議論を単純にす るために多重量子井戸を考える際にも各井戸は独立であ ると考える。また、以下に示される計算結果はすべて GaAs系量子井戸レーザについて行っている。

#### 2.3 線形利得

量子井戸レーザの利得の性質は種々の立場から議論が なされている<sup>19-30)</sup>.量子井戸レーザの利得特性の主たる 特徴としては、利得平坦化効果(Gain Flattening



図1 量子井戸構造の概念図と状態密度

Effects),量子井戸の厚さ,数に対する依存性,また遷移 行列の異方性などがあげられる。今,再結合過程が発光 再結合過程によって支配されているならば,線形バルク 利得は*k*-選択則のもとでは次のようにあらわされる。

$$g(E, n) = \frac{\omega}{n_r^2} \int_{n=0}^{\infty} \sum_{j=l,h} \rho_{\text{red}_n}(\varepsilon) \\ \times (f_c(E_{c_n}) - f_n(E_{c_n})) \hat{\chi}_1^{n,j}(E,\varepsilon) d\varepsilon \qquad (2)$$

ここでバルク利得は光電磁波が量子井戸活性層に100% 閉じ込められている場合の利得を意味する. Eは光子エ ネルギ, jは重い正孔( $\hbar$ ),軽い正孔(l)をあらわしてい る.また, $\rho_{red}$ は結合状態密度である.また, $E_{c_n}$ , $E_{c_j}$ は 電子,正孔のそれぞれの対応するエネルギを示す.また,  $\hat{\chi}^{r,i}(E,n)$ はエネルギEをもつそれぞれの電子—正孔対 によって生ずる複素感受率の虚部である.さらに, $f_cf_o$ は フェルミーディラック関数である.

さて半導体レーザの発振条件は、線形バルク利得に光 閉じ込め係数 $\Gamma$ をかけたモード利得 $g_{mod}$ が全体の損失に 等しくなることである.

すなわち

$$g_{\text{mod}}(E_l) = \Gamma g(E_l) = \alpha_{\text{total}} \tag{3}$$

もしキャリア密度(したがってフェルミエネルギレベル) がそれぞれの量子井戸で同じならば, N個のモード利得 は近似的に

$$g_{\text{mod}}^{N}(E_{l}) = N_{\text{mod}}^{(N-1)}(E_{l})$$
(4)

と書くことができる。ここで*E*はレーザ発振波長に対応 するものである。一方,注入電流においては次式のよう な関係がある。

$$J_{\rm th}^{N} = N J_{\rm th}^{(N=1)}$$
(5)

すなわち、多重量子井戸レーザでは単一量子井戸レー ザと比べ、N倍のモード利得が得られるが、その一方で 注入電流もN倍になる.図2(a)は、種々のNに対する



 図2 (a) 種々の軍ナカ戸の数を有するレーサのモードや時 (b) 利得平坦化の直観的説明



図3 いろいろな損失に対する量子井戸の数と閾値電流の関係

 $g_{mod}(E_i)$ の計算結果を示している. この図は, 単一量子井 戸レーザに おいては 著しい利得の 平坦化("gain flattening effect")が起こることを示している. この利 得の平坦化は状態密度が階段状であること, および擬 フェルミエネルギレベルが伝導帯, 価電子帯の中に浸透 していくことによって生ずるものである. このようすを 図 2 (b)に示しておく.

この利得の平坦化により、閾値電流の量子井戸の数に 対する依存性が次のようなものとなる.すなわち,発振 に必要な利得が小さいときは単一量子井戸レーザが最小 閾値電流を与えるが,必要利得が大になると,利得の平 坦化のため多重量子井戸レーザのほうがむしろ低い発振 閾値電流を与えることになる.この様子を示すために, 図3にいろいろな損失に対する量子井戸の数と閾値電流 の関係を示している.この図は,閾値電流を下げるため には,量子井戸の数を設計することが極めて有効である が,その最適値は損失にかなり依存することを示してい



図4 レーザ共振器を変えたときの発振波長の変化

る.また図には示していないが,量子井戸幅Lzを小さく していき電子の2次元性を強くすると閾値電流が低くな ることも明らかにされている.

利得の平坦化は最近高品質GRIN-SCH QWレーザに おいて実験的に観測されている<sup>31)</sup>.すなわち,利得の平坦 化が存在すると,発振に必要な利得が高い場合(損失が 大である場合),閾値電流が著しく増大する.このとき発 振波長を観測すると図4に示されるように,第1サブバ ンドに対する波長へのジャンプがみられる.これは利得 の平坦化により第1サブバンドに対応する波長から第2 サブバンドで利得が大になったこととともに,状態密度 が階段状になっていることを示す証拠ともいうことがで きる.

#### 3. 量子井戸レーザの微分利得および変調帯域幅

# 3.1 はじめに

半導体レーザの開発当初は閾値電流を下げることのみ が重要であったが、技術がすすむにつれ変調特性などの より高度な特性に関心が向けられ<sup>32-30)</sup>多くの研究がす でになされてきている。特に光通信システムの大容量化 という観点から変調帯域幅を拡大することは実用上大き な課題である。これまでダブルヘテロ接合レーザの共振 器長などの外的構造を変えることにより変調帯域幅の拡 大がはかられてきた。一方、もうひとつの方法として、 量子井戸構造を導入することにより、より基本的な材料 パラメータ自身を変え、特性の改善をはかることが考え られる。この章ではこのような量子井戸構造の導入によ る変調帯域幅の拡大について議論することにしたい。

# 3.2 微分利得および変調帯域幅

緩和振動周波数f,は変調帯域幅の直接的指標となる. これは次のようなレーザのダイナミックスに関するレー ト方程式を解析することにより得られる.

$$\frac{dn}{dt} = \frac{J(t)}{eL_z} - \frac{n_r}{c}g(n, E_l)P - \frac{n}{\tau_r}$$
(6)

$$\frac{dP}{dt} = \Gamma \frac{n_r}{c} g(n, E_t) P + \beta \frac{n}{\tau_s} - \frac{P}{\tau_p}$$
(7)

ここでPは光子密度, $\beta$ はレーザモードへの自然放出 係数, $r_s$ はキャリアの寿命,J(t)(cm<sup>-2</sup>)は活性層への注入 電流,nはキャリア濃度である。緩和振動周波数 $f_r$ は(5) (6)を小信号解析することにより次のように与えられ る、

$$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n_r g'(E_t, n) P_o}{c \tau_p}}$$
(8)

ここで $g'(E_{l,n})$ は微分利得 $(g'(E_{l,n}) = \partial(g'(E_{l,n}) / \partial n)$ である。式(8)は $f_r$ を増大させるために 3 つの方法 があることを示している。すなわち(1)  $\tau_p$ を下げること  $(2)P_0$ をあげること $(3)g'(E_{l,n})$ をあげることである。 (1)(2)のためにそれぞれ共振器長を短くすること<sup>34</sup>,



図5 伝導帯の電子の擬フェルミエネルギε<sub>Fc</sub>の関数として計 算されたダブルヘテロ接合レーザおよび量子井戸レー ザのg'(E<sub>i</sub>, n(ε<sub>Fc</sub>))

および窓型構造を用いること<sup>55)</sup>が提案されている.また, g'( $E_l, n$ )をあげるため低温での動作<sup>36)</sup>が試みられてい る.

 $g'(E_{l,n})$ の量子力学的表現は、さらにもうひとつの方 法を提案している。すなわち、量子井戸を用いることで ある。 $g'(E_{l,n})$ が $g(E_{l,n})$ のnに関する偏微分で与えら れることから明らかなように、 $g(E_{l,n})$ の場合と同様に 状態密度が重要な役割を果たす。量子井戸レーザでは、 状態密度関数が階段状であるため、バルクの場合と比べ て利得スペクトラムの幅が狭くなり、その結果 $g'(E_{l,n})$ が増大する。

図5は、ダブルヘテロ接合レーザおよび量子井戸レー ザのg'( $E_i$ , n( $\varepsilon_{Fc}$ ))を伝導帯の電子の擬フェルミエネル ギ $\varepsilon_{Fc}$ の関数として計算した結果である.ここで、量子井 戸の厚さは50Åとしている.価電子帯の擬フェルミエネ ルギは電気的中性条件によって定められている.この計 算結果は、量子井戸活性層を用いることにより、g'( $E_i$ , n)が増大することを示している.ここで注意しておくべ きことは、g'( $E_i$ , n)はバルクパラメータであり、した がってフェルミエネルギが同じである限り量子井戸の数 には独立な量である.

この図は、また、 $g'(E_i, n)$ が $\varepsilon_{Fc}$ に強く依存することを 示しており、このフェルミエネルギ依存性のため、 $f_r$ を最 大にする量子井戸の数Nが存在する.これを明らかにす るために再び式(3)をみてみよう.簡単のために、 $\alpha_{total}$ の量子井戸構造依存性を無視する.利得は $\varepsilon_{Fc}$ の単調増加 関数である.したがって、レーザ発振に必要な $\varepsilon_{Fc}$ はNの 増加に伴い減少する.したがって、微分利得を最大にす



図6 量子井戸の厚さL<sub>z</sub>の関数として計算された緩和振動周 波数

るフェルミエネルギ $\varepsilon_{rc}^{\max}$ を実現する最適なNが存在することになる。通常、N=1に対するレーザ発振時における $\varepsilon_{rc}$ は $\varepsilon_{rc}^{\max}$ より大であるので、 $f_r$ を最大にする $\varepsilon_{rc}$ は多重量子井戸(N>1)レーザにおいて実現される。

図 6 は,  $f_r \otimes \mathbb{I} = 2$ 結果を示している. ここで $\alpha_{total}$ は50cm<sup>-1</sup>としている. そ れぞれの $L_z$ でNは最適化されており,また,  $f_r$ はダブルへ テロ接合レーザ( $L_z \rightarrow \infty$ )の $f_r$ で正規化している. この結 果は,  $f_r$ は薄い量子井戸レーザにおいて約2倍ほど増大 することができることを示している.なお,量子井戸レー ザにおける $f_r$ の増大は,魚見ら<sup>38)</sup>により実験的にも観測 された.

#### 4. 量子井戸レーザにおける量子雑音

4.1 はじめに

最近、半導体レーザの雑音の問題が、コヒーレント光 通信や光計測への応用の観点から広く注目を集め始めて いる.1980年Flemingらによって、ダブルヘテロ接合レー ザにおけるスペクトル線幅が、従来よく知られている Shawlow-Townesの公式と比べて、相当広いことが見い だされた<sup>30)</sup>. この現象は、Henry<sup>40)</sup>およびVahal、Yariv ら<sup>41,42)</sup>によって独立に物理的に説明が加えられた. すな わち、彼らは半導体レーザにおけるスペクトル線幅が、  $(1+\alpha^2)$ 倍だけ大きくなることを理論的に見いだした. ここで、αは線幅増大係数と呼ばれるものである.直観的 に説明すると、次のようなことである. すなわち、位相 の揺らぎは、自然放出によるいわゆる位相揺らぎのみな らず、振幅の揺らぎがレーザ内部のキャリアの数の変動 をもたらす.これが屈折率の揺らぎを通じて結果的に位 相の揺らぎとなる.このスペクトル線幅をおさえるため に、外部ミラー、結合共振器構造あるいはDFB構造を用 いることが議論されてきている.もうひとつの方法とし ては、量子井戸構造を導入することが考えられる.ここ では、量子井戸構造を用いることにより、いかにαパラ メータが減少するかということについて説明する.

#### 4.2 スペクトル線幅

スペクトル線幅は、次式で与えられる.

$$\Delta v = \frac{V_g h v (\Gamma g) \cdot R_m n_{sp}}{\pi P} (1 + \alpha^2) \tag{9}$$

$$\alpha = \frac{\partial \chi_R}{\partial \chi_I} \frac{(E_L, n)}{(E_L, n)} \frac{\langle \partial n}{\partial n}$$
(10)

ここで, $R_m$ , $v_{g}$ ,hv, $\Gamma$ ,g, $n_{sp}P$ はそれぞれミラー損失, 光の郡速度,光子のエネルギ,光閉じ込め係数,レーザ 発振時におけるバルク利得,自然放出係数,光出力であ る.  $\chi_R(E,n)$ は複素感受率の実部である.

式(9)(10)は $\Delta\nu\nu i\alpha$ ,  $n_{sb}$ を通じて電子の状態密度に 依存することを示している。 $\Delta\nu$ を小さくするためには  $|\alpha|$ , $n_{sp}$ が小さくなることが必要である。式(10)の $\alpha$ の 表現において分母は $g'(E_{i},n)$ に比例している。したがっ て,前節の議論により,量子井戸構造の導入によりこの 値を増大させることができる。しかしながら,式(10)の 分子も量子井戸構造では増大する。したがって,数値計 算を用いずに $\alpha$ のふるまいを予測することは大変困難で ある。

図7はダブルヘテロ接合レーザおよび量子井戸レーザ に関して $\epsilon_{Fe}$ の関数として $\alpha$ を計算した結果を示す.この 図では、量子井戸の厚さを50Åとしている.これらの結 果は次のようなことを示している.すなわち、まず第一



 図 ? ε<sub>Fc</sub>の関数として計算されたダブルヘテロ接合レーザお よび量子井戸レーザのα

#### 39巻5号(1987.5)

に、 $\alpha$ が  $\varepsilon_{Fc}$ に強く依存することおよび  $\varepsilon_{Fc}$ の増加に伴い $\alpha$ の絶対値  $|\alpha|$  が減少することである(これらの傾向はす でにダブルヘテロ接合レーザについては理論的・実験的 に確かめられている<sup>(3)</sup>). 2番目は、 $|\alpha|$ の値がダブルヘ テロ接合レーザと比べて、小であることである.したがっ て、低い  $|\alpha|$ の値を得るためには、量子井戸構造を用い ること、また、単一量子井戸構造を用いることが望まし いことがわかる.なぜならば、量子井戸の数が少ないほ ど、レーザ発振に必要なモード利得を実現するために、 高い  $\varepsilon_{Fc}$ が要求されるからである.

# 6.量子井戸細線レーザ,量子井戸箱レーザの ダイナミックス

#### 6.1 はじめに

これまで述べたように半導体量子井戸レーザ井戸構造 は光デバイスの特性改善に大変有効であることが明らか になった.量子井戸構造では電子が膜厚方向にその自由 度を失ってその結果2次元電子ガスを形成するわけであ るが,最近,この拡張として電子を2次元的,3次元的 に閉じ込めることが世界のいくつかの研究機関で始まり つつある.1982年荒川・榊が提案したこのような構造の 半導体レーザへの導入はその先駆的な仕事の一つであ る.また,最近荒川,ヤリフによりこのような構造が半











図9 量子井戸細線レーザの微分利得とaパラメータ

導体レーザの変調特性, 雑音特性の改善に有効であるこ とが明らかにされた.本章では量子井戸細線レーザや量 子井戸箱レーザにおけるレーザ特性の改善について論じ ると共に,強磁場を用いた量子井戸細線レーザや量子井 戸箱レーザの等価的実現をはかった結果についても述べ る.

## 6.2 量子井戸細線レーザ,量子井戸箱レーザ

図8(a)は,量子井戸,量子井戸細線,量子井戸箱レー ザの簡単な概念図である.このような多次元的量子井戸 構造をつくることにより電子の動きの自由度が0もしく は1に減少する.このような構造における電子の状態密 度は次のように示される.

$$\rho_{c}^{\text{wire}}(\varepsilon) = \left(\frac{m_{c}}{2\hbar^{2}\pi^{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{l,m} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon - \varepsilon_{l} - \varepsilon_{m}}}$$
(11)

$$\rho_c^{\text{box}}(\varepsilon) = \sum_{l,m,k} \delta(\varepsilon - \varepsilon_l - \varepsilon_m - \varepsilon_k)$$
(12)

ここで $\epsilon_{t}$ ,  $\epsilon_{m}$ , および $\epsilon_{k}$ は, 量子井戸内の量子化されたエ ネルギレベルである.図8(b)に示されているように, 自由度の減少に伴い,状態密度関数の形がピーク化され る.この変化に伴い,利得の形状が変化し,閾値電流特 性の改善が行われる.これらのレーザのダイナミックス について議論することにしよう.

電子の自由度の減少に伴い、利得の形状が狭くなり、 これが高い微分利得に結び付く.図9のカーブのひとつ は、量子井戸細線レーザに関する微分利得をフェルミエ ネルギの関数としてプロットしたものである.図5と比 較することにより次の2つの特徴が明らかになる.すな わち、量子井戸細線構造を用いることにより高い微分利 得が得られる.もうひとつは、微分利得のフェルミエネ ルギ依存性が、量子井戸細線レーザの場合強調されるこ とである.したがって、より高い微分利得が、前の議論



と同様にして、多重量子井戸細線構造において得られる とともに、数に対する微分利得の感度は、量子井戸レー ザと比べてさらに強調される.

図10のひとつのカーブは、量子井戸細線の $f_r \varepsilon L_z$ の関数としてプロットしたものである。この計算では、2つの量子井戸細線の量子的寸法が等しく( $L_z = L_y$ ),またその数は各 $L_z$ で最適化している。この結果は、 $f_r$ がダブルヘテロ接合レーザの場合と比べて3倍近く強調されることを示している。

量子井戸細線レーザのスペクトル特性も改善される. 図9のもうひとつのカーブは $\alpha$ パラメータのフェルミエネルギ依存性を示している.この図に示されるように、  $\alpha$ パラメータの依存性は、量子井戸レーザの場合と比較して小さくなっている.図10のもうひとつのカーブはスペクトルライン幅 $\Delta \nu$ を量子的寸法 $L_z$ の関数として計算したものである.この図は、 $\alpha$ パラメータの絶対値が $L_z$ の減少とともに減少することを示している.

量子井戸箱レーザにおける $\alpha$ パラメータについて若干 述べておこう。もし、高次のサブバンドの効果を無視す れば、状態密度は $\delta$ -関数状と考えることができる。した がって、最大利得を与える光子エネルギが、量子化エネ ルギに一致する。このため、複系感受率の実部が0に近 づく、したがって、量子井戸箱レーザでは、 $\alpha$ パラメータ が極端に小さくなる。また、同時に $f_r$ もさらに増大する。

# 6.3 強磁場による量子井戸細線レーザ,

### 量子井戸箱レーザの等価的実現

量子井戸細線,量子井戸箱構造に対する関心は大変高 まっており,おそらく世界で10グループ以上が精力的に 研究をすすめていると思われる。しかしながら,現段階 では実現されていない。これらの効果を実現するもうひ とつの方法は,強磁場を用いることである<sup>44-46</sup>.磁場内 では電子はローレンツ力を磁場と垂直な平面内で受け, サイクロン運動をする.このため、磁場が十分強いとき には、2次元的量子束縛が生じる.したがって、1次元 電子システムはダブルヘテロ接合レーザを強磁場の中に おくことにより、0次元電子システムは量子井戸レーザ を磁場の方向と量子井戸面が垂直になるように置くこと により実現することができる.

図11は、190kにおいて、強磁場内のGaAsダブルヘテロ 接合レーザのスペクトル線幅を測定した結果を、光出力 powerの逆数の関数としてプロットしたものである.こ の図に示されているように、ライン幅が磁場の増加に伴 い、減少していることがわかる.これは.スペクトル線 幅が、擬1次元電子システムの形成により改善されてい ることを示している.またごく最近では量子井戸レーザ を強磁場に置き、量子井戸箱レーザを等価的に実現し、 そのスペクトル線幅の減少を観測することにも成功し た.

一方, frの改善もダブルヘテロ接合レーザを強磁場に おくことにより観測された.



図11 強磁場内のAlGaAsダブルヘテロ接合レーザの スペクトル線幅





図12は,磁場20eslaが印加された場合と、されない場合 のダブルヘテロ接合レーザのf,を、出力パワーP。の平方 根の関数としてプロットしたものである.f,はすでに述 べたように、P。の平方根に比例するが、この図において 各磁場における測定点が同一直線上にのっていること は、このことを支持している.さらに、磁場を印加した 場合、その傾きが増大している.B=20eslaの磁場の印加 に伴い、f,は約1.4倍ふえることが示された.これは、微 分利得の変化としては約1.9倍に対応するものであり、量 子細線効果によるものと考えられる.

#### 7.結論

本解説では、量子井戸レーザのダイナミックスの物理 を明らかにし、構造パラメータである量子井戸幅、量子 井戸の数等のこれらの特性に及ぼす効果について議論し た.また、量子井戸細線子井戸すなわち量子井戸細線効 果の基礎研究として、この構造内に閉じ込められた電子 系とダイナミックスの関係について理論的に議論し、あ わせて強磁場を用いた実験結果も示した.本解説は紙面 の都合もあって、最近話題になっている量子井戸構造を 用いた新しい光デバイスについてはふれることができな かった.より詳細な議論や文献リストを知りたい方は文 献47)を参照されたい.現在量子井戸構造の分野の研究者 はますます増加しており、今後、さらに新しい概念を伴 う高性能量子井戸光デバイスが実現されることが期待さ れる. (1987年3月9日受理)

#### 参考文献

- J.P.van der Ziel, R.Dingle, R.C.Miller, W. Wiegmann, and W.A.Nordland Jr.; Appl. Phys. Lett. 26, 463-465 (1975)
- N.Holonyak, Jr. R.M.Kolbas, R.D.Dupuis, and P.D.Dapkus; IEEE J. of Quantum Electron. 170-181, (1980)
- W.T.Tsang; Appl. Phys. Lett. 39, 786-788, (1981)
- T.Fujii, S.Yamakoshi, K.Nanbu, O.Wada, S. Hiyamizu; J. Vac. Sci. and Technol., 2, 259-261 (1984)
- S. Chin, N. Holonyak, Jr., B.A. Bojak, K. hess, R. D. Dupuis, and P. D. Dapkus; Appl. Phys. Lett. 36, 19-21 (1979)
- K.Hess, B.A.Bojak, N.Holonyak, Jr., R.Chin, and P.D.Dapkus; Solid-State Electron., 23, 585-589, (1980)
- Y.Arakawa and H.Sakaki; Appl. Phys. Lett. 40, 490-492 (1982)
- Y.Arakawa, K.Vahala, and A.Yariv; Appl. Phys. Lett. 45, 950-952 (1984)
- 9) Y.Arakawa and A.Yariv; IEEE J. Quantum Electron., QE-21, 1096 (1985)
- 10) Y.Arakawa, K.Vahala, and Yariv; 2nd

International Conference on Modulated Semiconductor Structures, Kyoto, Japan (1985)

- Y.Arakawa, A.Larsson, J.Paslaski, and A. Yariv; Appl. Phys. Lett., 48, 561 (1986)
- 12) A.Larsson, M.Mittelstein, Y.Arakawa, and A. Yariv; Electron. Lett. 22, 79 (1986)
- K.Kaede, Y.Arakawa, P.Derry, J.Papaslaski, and A.Yariv; Appl. Phys. Lett. 48, 891 (1986)
- 14) Y.Arakawa, K.Vahala, A.Yariv K.Lau; Appl. Phys. Lett. 1142-1144 (1986)
- 15) Y.Arakawa, K.Vahala, A.Yariv, and K.Lau; Appl. Phys. Lett. 47, 1145 (1986)
- 16) H.Kromer and H.Okamoto; Jpn. J. Appl. Phys., 23, 970-972 (1984)
- 17) A.Yariv, C.Lindsey, U.Sivan; J. Appl. Phys., 58, 3669-3671 (1985)
- 18) R.Lang and K.Nishi; Appl. Phys. Lett., 45, 98 (1984)
- D.Kasemset, C.S.Hong, N.B.Patel, and D. Dapkus; IEEE J. Quantum Electron., QE-19, 1025-1030, (1983)
- 20) A.Sugimura; IEEE J. Quantum Electron. QE-20, 336-343, (1984)
- P.T.Landsberg, M.S.Abrahams, and M. Olsinski; IEEE J. Quantum Electron. QE-21, 24-28 (1985)
- 22) N.K.Dutta; J. Appl. Phys. 53, 7211-7214, (1982)
- 23) N.K.Dutta; IEEE J. Quantum Electron. QE-19, 794-797, (1983)
- 24) H.Kobayashi, H.Iwamura, T.Saku, and K. Otsuka; Electron. Lett. 19, 166-168, (1983)
- M.Asada, A.Kameyama, and Y.Suematsu: IEEE J. Quantum Electron. QE-20, 745-753, (1984)
- 26) M.Yamanishi and I.Suemune; Japan J. Appl. Phys. 23 L35-L36, (1984)
- M.Yamada, S.Ogita, M.Yamagishi, and K. Tabata; IEEE J. Quantum Electron. QE-21, 640-645, (1985)
- 28) M.Yamada, K.Tabata, S.Ogita, and M. Yamagishi; Trans. IECE Japan, E68, 102-108, (1984)
- 29) Y.Arakawa, H.Sakaki, M.Nishioka, J.Yoshino, and T.Kamiya; Appl. Phys. Lett, (1985)
- 30) N.K.Dutta, R.L.Hartman, and W.T.Tsang; IEEE J. Quantum Electron. QE-19, 1243-1246 (1983)
- 31) M.Mitte;stein, Y.Arakawa, A.Larsson, and A. Yariv: International Quantum Electronics Conference, Post Deadline Paper June (1986)
- 32) T.Ikegami, and Y.Suematsu; Electron. Commun. Jpn. B51, 51-58 (1968)
- 33) T.P.Paoli and J.E.Ripper; Proc. IEEE 58, 1457 (1970)
- 34) K.Y.Lau, N.Bar Chaim, I.Ury, C.Harder, and A.Yariv; Appl. Phys. Lett., 43, 1-3, (1983)
- 35) K.Y.Lau, N.Bar-Chaim, I.Ury, and A.Yariv; Appl. Phys. Lett. 45, 345-347 (1984)

7

- 36) K.Y.Lau and A.Yariv; IEEE J. of Quantum Electron., QE-21, 121-137 (1985)
- 37) K.Vahala and A.Yariv; Appl. Phys. Lett., 45, 501-503, (1984)
- 38) K.Uomi, N.Chinone T.Ohyoshi, and T. Kajimura; Japan J. Appl Phys. 24, L539-L541, (1985)
- 39) M.W.Fleming and A.Mooradian; Appl. Phys. Lett., 38, 511-513, (1981)
- 40) C.Henry; IEEE J. of Quantum Electron., QE-18, 259-264, (1982)
- 41) K.Vahala and A.Yariv; IEEE J. of Quantum Electron. QE-18, 1096-1101, (1982)

42) K.Vahala and A.Yariv; IEEE J. of Quantum Electron. QE-18, 1102-1109, (1982)

生産研究

- 43) Y.Arakawa and A.Yariv; Appl. Phys. Lett., 47, 905-907 (1985)
- 44) Y.Arakawa, H.Sakaki, M.Nishioka, and N. Miura; IEEE. of Quantum Electron. QE-18, 1255 (1983)
- 45) Y.Arakawa, H.Sakaki, M.Nishioka, and N. Miura; IEEE Trans. on Electron Devices, ED -30,4, 330 (1983)
- 46) H.J.A.Bluyssen and L.J.van Ruyven; IEEE J. of Quantum Electron., QE-16, 29-33 (1983)
- 47) Y.Arakawa and A.Yariv; IEEE. J. of Quantum Electron., QE-21 (1986)

